

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО"

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «13» сентября 2023 года

№ 15/797

В соответствии с «Регламентом о порядке отчисления обучающихся из федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО» утверждаю следующие составы и графики заседаний комиссий института "Высшая инженерно-техническая школа" по проведению повторной промежуточной аттестации у обучающихся, получивших задолженности в течение промежуточной аттестации весеннего семестра 2022/2023 учебного года (Приложение).

Декан факультета Институт
ВИТШ



(личная подпись)

А.В. Куликов
(ФИО)

Приложение к распоряжению № _____ от " ____ " _____ 2023 года

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
<p>Комиссия №1 председатель: Вознесенская А.О. секретарь: Сквородкина М.В. члены комиссии: • Алейник А.С. • Баходдин А.В. • Ежова В.В. • Цыганок Е.А.</p>	Заседание №1 25.10.2023, 15:00, ZOOM	CAD системы	E4271, САПС 1.1
	Заседание №2 01.11.2023, 15:00, ZOOM	Анализ и проектирование оптических систем	Q4210
	Волоконно-оптические информационно-измерительные системы	E4271	
	Волоконные брэгговские решетки	E4271	
	Геометрическая оптика	B33001, B33002, B33003, L33161, L33162, L33181, L33182	
	Дизайн оптических систем	E4200с, ДО, ДОС 1.1.1	
	Дизайн оптических систем / Optical System Design	OSD 1.1	
	Интегральная оптика	E4271	
	Источники и приемники оптического излучения	B34001, B34002, B34003	
	Концептуализация (Постановка задач)	E4271	
	Критическое обоснование (Часть I)	E4271	
	Критическое обоснование (Часть II)	E4271	
	Методы обработки изображений	E4200с, МОИ 1.1	
	Методы оптического контроля	МОК 1.1, МОК 1.2	
	Метрология оптико-цифровых систем	E4200с, МОЦ 1.2	
	Моделирование оптических систем	E4271	
Научно-исследовательская работа	Пр12572		
Оптические детекторы	E4200с, ОТД 1.1		
Основные уравнения	E4271		

Состав и номер комиссии	Сроки заседания/ место проведения комиссий	Дисциплины	Группы
		математической физики	
		Практическая электроника	E4271
		Проектирование оптических линий связи	E4271
		Проектная деятельность	B33001, B33002, B33003
		Производственная, профессиональные стажировки	E4200с, Пр12377
		Разработка оптико-цифровых систем	E4200с, РОЦС 1.1
		Световодная фотоника	B34001, L34162, L34182
		Световые системы	P33311
		Структурирование оптического изображения	E4200с, СОИ 1.1
		Физическая оптика	E4271
		Фотоника	E4271
		Электроника	L34161, L34162, L34181